

# 名古屋大学 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設 第3回ユーザーズミーティング

日時: 平成31年3月14日(木)13時00分～17時00分  
場所: 名古屋大学 VBL3階 ベンチャーホール

## 趣旨

本学超高压電子顕微鏡施設は、2010年反応科学超高压走査透過電子顕微鏡の導入及び2011年文部科学省ナノテクノロジープラットホーム微細構造解析への参画を機に大きく生まれ変わりました。最先端の電子顕微鏡を幅広い分野のご研究に更に生かしていただくために、学内外のユーザーの方々を対象に施設の技術情報の公開及び施設スタッフとの交流を図る目的で、昨年度に引き続き今年度も第3回ユーザーズミーティングを企画いたしました。是非この機会を利用して皆様の施設へのご意見・ご要望などをいただければ幸いです。

## プログラム

13:00 挨拶 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設 施設長 武藤 俊介

13:10 特別講演

「新規導入のHITACHI製FIB/SEM ETHOSの紹介」

株式会社 日立ハイテクサイエンス 中谷 郁子

- 休憩 -

14:00 ユーザー講演①

「プラズマ照射下その場透過電子顕微鏡観察システムの開発」

工学研究科 近藤 博基

14:30 ユーザー講演②

「無機化合物における結晶転位のコア構造と機能」

工学研究科 中村 篤智

- 休憩 -

15:20 ユーザー講演③

「超高压電子顕微鏡施設を活用した全固体Li電池の研究開発」

工学研究科 入山 恭寿

16:00 ユーザー講演④

「高性能電子顕微鏡技術と連携した自動車排ガス浄化触媒のナノ組織制御」

未来材料・システム研究所 小澤 正邦

16:40 技術相談(希望者のみ、個別対応)